

*Міністерство освіти і науки України
Запорізький національний університет
Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні*

*Кафедра: Електроніки, інформаційних систем та програмного
забезпечення*

Практичне заняття 14

з дисципліни Аналогова та оптосхемотехніка

Дослідження оптоелектронного сенсора абсолютних кутових положень

Студента (ки) 2 курсу, групи _____

(прізвище та ініціали)

Викладач _____

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Національна шкала _____

Кількість балів: _____ Оцінка: ECTS _____

м. Запоріжжя – 202_ рік

Метою вивчення теми є засвоєння принципів побудови оптоелектронних енкодерів.

Ключові терміни та поняття: переміщення, енкодер, оптичний сигнал, інтерферометр, сенсор, код.

План самостійного опрацювання теми.

1. Методи вимірювання кутових координат.
2. Аналіз методів вимірювання кутового положення.
3. Абсолютні оптичні енкодери.
4. Конструкція оптичного абсолютноного енкодера.

Методичні вказівки до вивчення питань та виконання завдань.

Лазерні вимірники переміщень, розроблені на основі лазерних інтерферометрів Майкельсона або лазерних доплерівських інтерференційних перетворювачів, не мають механічного контакту з об'єктом і забезпечують можливість дистанційних вимірювань швидкості і довжини з високою точністю.

Відомі інтерференційні вимірники лінійних переміщень, які містять лазерне джерело випромінювання, оптичний інтерферометр Майкельсона з фотоелектричною системою перетворення модульованого світлового потоку в послідовності прямокутних імпульсів і процесор для фіксації результатів вимірювання. Частота дотримання прямокутних імпульсів відповідає швидкості об'єкту, а період дотримання цих імпульсів відповідає половині довжини хвилі стабілізованого по частоті лазера. Переміщення об'єкту фіксується уздовж лазерного пучка вимірювального плеча інтерферометра. Такі вимірники призначенні для прецизійних абсолютнох вимірювань довжини. Вони дозволяють вимірювати довжину з високою роздільністю (долі нанометра) і точністю. Максимальна вимірювана довжина залежить від потужності випромінювання лазера і не перевищує декілька десятків метрів. Такі вимірники вимагають при їх створенні дорогих оптичних вузлів і не дозволяють використовувати їх в тих випадках, коли поверхня об'єкту вимірювання є розсіюючою, а не дзеркальною.

Відомі лазерні вимірники довжини, побудовані на основі лазерних доплерівських інтерференційних перетворювачів швидкості рухомих об'єктів. Лазерний інтерференційний перетворювач виконує пасивні функції і призначений для формування уявних або дійсних граток інтенсивності, що проектируються за допомогою оптичної системи на об'єкт переміщення. Інтерференційні гратки задають необхідну метрику простору. Інтерференційний сигнал виходить за рахунок дифракції світла на частках, що пересікають світлові гратки. На практиці широко використовується схема, де два пучки двопроменевого інтерферометра фокусуються об'єктивом в досліджувану область. При пересіченні пучків під певним кутом утворюються інтерференційні гратки. Розсіювальна частка об'єкту переміщення, яка проходить крізь такі гратки, дає імпульс сигналу на фотодетекторі, що модулюється з частотою, зворотною періоду гратки і пропорційної швидкості переміщення об'єкту. Вимірюючи частоту сигналу при відомій довжині хвилі лазера і геометрії інтерферометра, можна визначити швидкість руху об'єкту, а підсумовуючи значення

швидкості, помноженої на час між відліками швидкості, - величину переміщення об'єкту за повний час його руху. Такі вимірювачі дозволяють вимірювати чималі переміщення (десятки і більше метрів) об'єктів з дифузно відзеркальною поверхнею. Погрішність таких вимірювачів досить висока і складає десятки мікрон.

Відомі лазерні інтерферометри лінійних переміщень, засновані на явищах оптичного зворотнього зв'язку в напівпровідникових лазерах [16]. Такі вимірювачі переміщення містять напівпровідниковий лазер із вбудованим в нього фотодіодом. Випромінювання лазера через коліматор прямує на об'єкт переміщення. До складу інтерферометра входять також трансімпедансний підсилювач, низькочастотний фільтр, два формувачі рахункових імпульсів, реверсивний лічильник імпульсів і дисплей результату вимірювання. Вказані вимірювачі не вимагають дорогих оптических вузлів і дозволяють вимірювати переміщення об'єктів з дифузно відзеркальною поверхнею в діапазоні від декількох десятків сантиметрів до 2-2,5 метрів. При цьому роздільна здатність вимірювачів дорівнює половині довжини хвилі випромінювання напівпровідникового лазера. Такий вимірювач переміщення не дозволяє проводити вимірювання переміщення з манометричною роздільністю.

Відомі також вимірювачі дальності, засновані на використанні як на явищі оптичного зворотного зв'язку, так і частотної модуляції випромінювання в напівпровідникових лазерах. Датчиком інтерференційного сигналу є напівпровідниковий лазер із вбудованим фотодіодом і використання таких датчиків у вказаних вимірювачах дозволяє практично виключити вживання елементів традиційної оптики. В основі таких вимірювачів покладена властивість напівпровідникових лазерів змінювати частоту випромінювання під впливом змін інжекційного струму.

Близьким за технічним рішенням до зазначених вище вимірювачів, є лазерний вимірювач відстані до об'єкту. Вимірювач відстані містить напівпровідниковий лазер з фотоприймальним пристроєм, оптично зв'язаним через коліматор з об'єктом, відстань до якого потрібно виміряти, модулятор струму лазера, блок терmostабілізації лазера і електронний блок обробки вихідного сигналу фотоприймача, що забезпечує набуття значення дальності до об'єкту з погрішністю 1-1.5 мм. У цьому пристрої також використовується властивість оптичного зворотного зв'язку і частотна модуляція випромінювання лазера. Проте цей вимірювач не дозволяє вимірювати переміщення об'єкту. У роботах [17] для пристрій з датчиками інтерференційного сигналу, приведені залежності між характеристиками інтерференційного сигналу (частота, фаза) і величинами деяких вимірюваних параметрів, наприклад відстані до об'єкту, його швидкості і переміщення. Показано, що при використанні даних датчиків (лазер плюс фотодіод) дальність (відстань до розсіюючого об'єкту) визначається частотою інтерференційного сигналу. Якщо об'єкт нерухомий, то частота інтерференційного сигналу строго відповідає відстані до об'єкту. Величину переміщення розсіюючого об'єкту можна визначити шляхом обчислення зсуву фази інтерференційного сигналу, що виникає при переміщенні об'єкту. Ці положення і використані в пропонованому технічному рішенні.

Схема прототипу оптоелектронного сенсора абсолютних кутових положень

У розглянутому лазерному вимірювачу дальності і лінійних переміщень вказаний недолік прототипу (неможливість виміру переміщень) усувається за рахунок того, що в електронний блок обробки сигналу фотодіода введені нові електронні вузли. Ці вузли забезпечують формування не лише сигналів, що забезпечують вимір дальності до об'єкту, але і сигналів, що дозволяють виконувати вимір і підрахунок цілого числа періодів інтерференційних смуг і величини його дробової частини, що і забезпечує вимір величини переміщення.

Вимір цих параметрів досягається за рахунок того, що в лазерному вимірювачу дальності, що містить напівпровідниковий лазер з фотоприймальним пристроєм, введений операційний пристрій, до неінвертуючого входу якого підключений вихід фотодіода, а інвертуючий вихід сполучений з першим додатковим вихідом модулятора. Це дозволяє у вихідному сигналі фотодіода усунути принципово присутню перешкоду, обумовлену модуляцією струму лазера. До другого додаткового вихіду модулятора послідовно приєднані формувачі синхроімпульса і стробімпульса, що забороняють роботу пристрою на час переходного процесу, викликаного стрибкоподібною зміною модуляційного струму. До вихіду операційного пристрою послідовно підключені компаратор і перший вихід блоку формування трьох імпульсних сигналів. Вихідним сигналом компаратора є послідовність прямокутних імпульсів з частотою інтерференційного сигналу. Другий вихід блоку формування трьох імпульсних сигналів сполучений з вихідом формувача стробімпульса. Перший і другий виходи згаданого блоку формування сполучені відповідно з вимірювачами тривалості початкової фази і періоду інтерференційного сигналу, а виходи вказаних вимірювачів і третій вихід формувача трьох імпульсних сигналів сполучені з шиною комп'ютера. Вимірювачі тривалості перетворюють свої вхідні сигнали в цифровий код. Прийом даних від вимірювачів і формувача трьох імпульсів і управління їх роботою здійснюється по шині комп'ютера.

Новизною, вибраного прототипу, є введення елементів пристрою зв'язку між ними. До них відносяться: операційний пристрій, один з входів якого підключений до першого додаткового вихіду модулятора струму напівпровідникового лазера з метою компенсації модуляційної перешкоди у вихідному сигналі фотодіода; формувач синхроімпульсів і формувач імпульсів фіксованої тривалості (стробімпульс), що забороняють роботу пристрою на час переходних процесів; компаратор, що формує імпульси з частотою інтерференційного сигналу; блок формування трьох імпульсних сигналів і вимірювачі (у цифровому вигляді) його вихідних сигналів; комп'ютер, управління роботою пристрою.

На рисунку 14.1 представлена схема лазерного вимірювача дальності і лінійних переміщень.

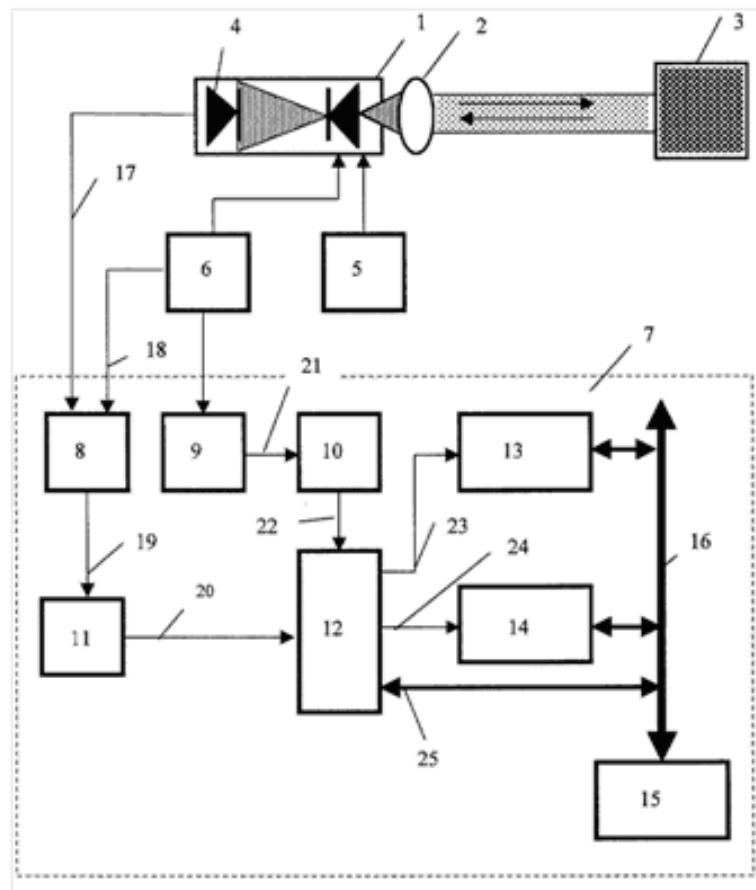


Рисунок 14.1 – Лазерний вимірювач переміщень

Лазерний вимірювач переміщень містить напівпровідниковий лазер 1, оптично зв'язаний через коліматор 2 з об'єктом 3, відстань до якого потрібно виміряти, вбудований в напівпровідниковий лазер фотоприймач 4, блок термостабілізації 5, модулятор 6 струму лазера, підключений до напівпровідникового лазера, і електронний блок обробки 7 обробки вихідного сигналу фотоприймача. Напівпровідниковий лазер і фотоприймач утворюють датчик інтерференційного сигналу. Електронний блок обробки 7 містить операційний пристрій 8, формувач 9 синхроімпульсів, формувач 10 стробоскопічних імпульсів фіксованої тривалості. У електронному блоку обробки 7 також входять компаратор 11, блок формування 12 трьох імпульсних сигналів, блоки 13 і 14 вимірювання відповідно тривалості поточної фази і періоду інтерференційного сигналу, комп'ютер 15 для обчислення результату вимірювання і шина 16 даних і управління для зв'язку комп'ютера з блоками 12-14. Неінвертуючий і інвертуючий входи операційного пристроя 8 позначені відповідно цифрами 17 і 18. Фотоприймач 4 напівпровідникового лазера 1 сполучений з неінвертуючим входом 17 операційного пристроя 8, що інвертує вхід 18, який сполучений з першим додатковим вихідом модулятора струму лазера. Вихідні сигнали блоків 8, 11, 9 і 10 позначені відповідно цифрами 19, 20, 21 і 22, а вихідні сигнали формувача 12 позначені цифрами 23, 24 і 25. На вихіді 19 операційного пристроя 8 формується інтерференційний сигнал.

Працює пристрій таким чином. Струм напівпровідникового лазера 1 змінюється модулятором 5 по лінійному закону. В даному випадку модуля-

ційний струм змінюється по пилкоподібному закону. Модульований таким чином пучок через коліматор 2 прямує на досліджуваний об'єкт. Розсіяне ним випромінювання потрапляє назад в активне середовище лазера, де посилюється і інтерферує з вихідним випромінюванням, оскільки із-за кінцевого значення швидкості світла розсіяне випромінювання приходить в напівпровідниковий лазер з деякою затримкою. Унаслідок цієї затримки частота цього випромінювання не збігається з частотою, що генерується напівпровідниковим лазером в даний момент. В результаті на виході вбудованого в напівпровідниковий лазер 1 фотодіода 4 виникає електричний сигнал, параметри якого несуть інформацію про відзеркальну поверхню об'єкту, його віддаленість і характеристики руху. При модуляції лазера пилкоподібним струмом змінюється не лише частота випромінювання, але і потужність лазера. Тому сигнал на виході фотодіода 4, окрім корисної інтерференційної частини, містить пилкоподібну перешкоду. Ця перешкода фільтрується завдяки тому, що на інверторуючий вхід операційного пристрою 8 подається сигнал пилкоподібної модуляції з першого додаткового виходу модулятора 6. Вихідний сигнал 19 операційного пристрою 8 поступає на вхід компаратора 11 і перетворюється на його виході 20 в послідовність прямокутних імпульсів. Ці імпульси поступають на перший вхід формувача 12 трьох імпульсних сигналів, на другий вхід якого поступає стробімпульс з формувача 10. Синхроімпульс формувача 9, що запускається сигналом з другого додаткового виходу модулятора, з'являється на початку кожного циклу модуляції на виході 21 і запускає формувач 10, вихідний імпульс якого використовується у формувачі 12 трьох імпульсних сигналів для заборони проходження інтерференційного сигналу з виходу 20 компаратора 11 на якийсь час, що відповідає переходному процесу під час стрибкоподібної зміни пилкоподібного модулюючого струму.

Для виміру дальності комп'ютер обчислює частоту інтерференційного сигналу як величину, зворотню вимірюному періоду. Для фіксації результату виміру дальності в метричній системі одиниць значення частоти перемножається на відповідний коефіцієнт пропорційності.

Для виміру величини переміщення комп'ютер використовує інший алгоритм: значення відрізків часу, відповідних поточній фазі і періоду інтерференційного сигналу, використовуються комп'ютером для обчислення поточній фази, вираженої в частинах періоду інтерференційного сигналу. Частота зчитування цих інтервалів часу повинна, щонайменше, перевищувати частоту модуляції струму лазера в чотири рази. При переміщенні об'єкту комп'ютер порівнює значення поточної і попередньої фаз. Якщо він виявляє стрибок фази, абсолютне значення якого перевищує 0.5 періоду, то залежно від знаку цього стрибка до поточного значення фази додає один період. Якщо знак стрибка негативний, то одиниця підсумовується із знаком плюс, а якщо знак стрибка позитивний, то одиниця підсумовується із знаком мінус. Знак стрибка фази визначає напрям руху об'єкту, а підсумована одиниця свідчить про те, що об'єкт переміщення змістився на величину, рівну одному періоду інтерференційного сигналу. Результат виміру переміщення фіксується в елементі пам'яті комп'ютера як сума цілого значення періодів інтерференційних смуг і

дробової частини інтерференційної смуги. Результат виміру переміщення з початкового положення в кінцеве положення обчислюється як різниця значень кінцевої і початкової фаз інтерференційного сигналу. Для здобуття результату переміщення, представленого в метричній системі одиниць, комп'ютер перемножає різницю значень фаз інтерференційного сигналу на значення половини довжини хвилі випромінювання напівпровідникового лазера.

Система реєстрації оптоелектронного сенсора абсолютнох кутових положень

У якості реєструючої частини пропонується використати дифракційну решітку, яка розташовується безпосередньо на об'єкті дослідження.

Основним елементом датчика, схема якого наведена на рисунку 14.2, є блок-сенсор, який є прозорою пластинкою товщиною кілька міліметрів.

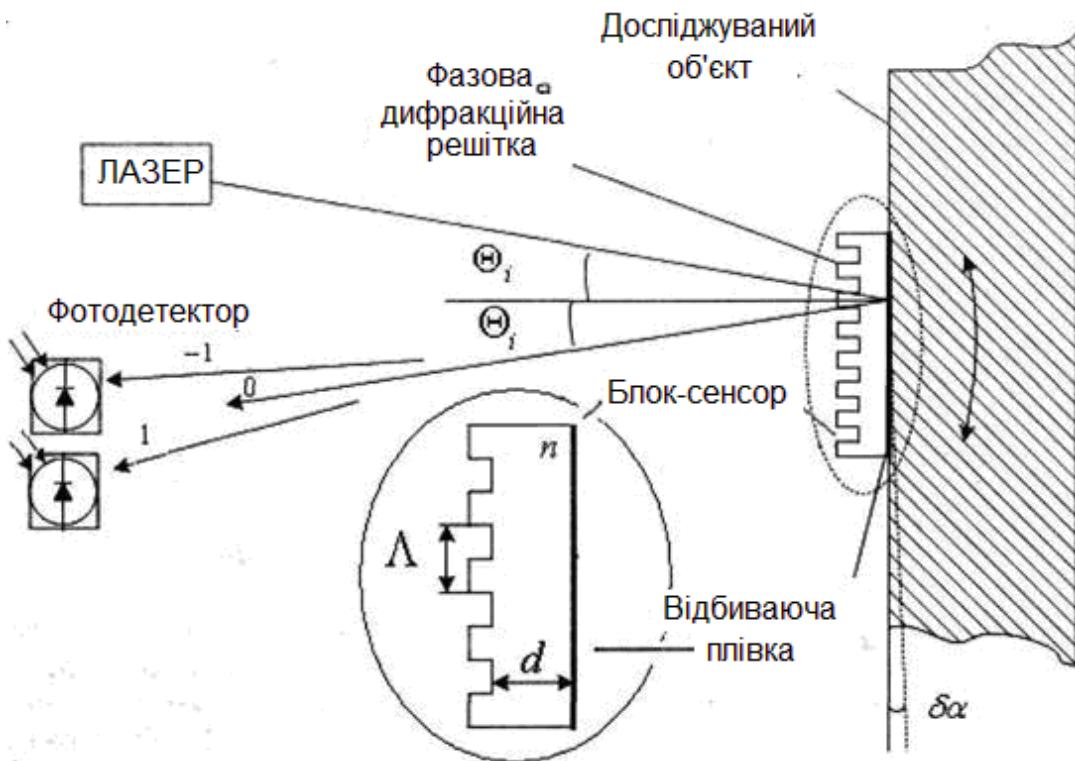


Рисунок 14.2 – Система реєстрації оптоелектронного сенсора абсолютнох кутових положень

На одній стороні пластини знаходитьсья фазова дифракційна решітка з профілем у вигляді меандру, а на іншій стороні - дзеркальна плівка, яка відбиває.

Блок-сенсор закріплюється на досліджуваній конструкції та просвічується оптичним лазерним випромінюванням. Промінь лазера, спрямований на блок, дифрагує на фазових дифракційних гратах, поширюється в прозорому

матеріалі пластиини, відбивається від дзеркальної плівки і повторно дифрагує на фазових гратах.

Таким чином, в основі роботи пристрою, як і в попередньому випадку, лежить подвійна дифракція оптичного пучка на фазових дифракційних гратах, що має профіль у вигляді меандра.

При нахилі ділянки конструкції на невеликий кут відбувається нахил блоку-сенсора. Це викликає усунення слідів падаючого та відбитого пучків по поверхні решітки. Якщо замінити відбитий промінь дзеркально симетричним, то можна замінити аналіз взаємодії оптичного пучка з блоком-сенсором аналізом еквівалентної схеми з двох решіток, що знаходяться на відстані, що дорівнює подвоєній товщині блока-сенсора.

Звідси у припущені малого кута падіння 0 для блока-сенсора з решіткою, що має оптимальне значення амплітудної фазової модуляції $\Phi_m=45^\circ$, можна отримати вираз, що описує залежності потужностей випромінювання в перших порядках дифракційних від кута нахилу а:

$$P_{\pm 1}(\alpha) = P_0 R \left[\frac{2}{\pi^2} + \frac{2}{\pi^2} \cos \left(\frac{4\pi d}{n\Lambda} \alpha \mp L' \right) \right] \quad (2.1)$$

Тут P_0 - падаюча потужність оптичного випромінювання; R - коефіцієнт відбиття дзеркальної плівки; d – товщина скляної пластиини блока-сенсора; $L' = 2d\pi\lambda/n\Lambda^2$ - параметр відстані.

Для реєстрації та вимірювання малих кутових коливань використовується одна з безлічі лінійних ділянок гармонійної залежності потужності випромінювання одного з перших порядків дифракції від кута нахилу блока-сенсора – $P_{-1}(\alpha)$ або $P_{+1}(\alpha)$. Для роботи пристрою потрібно забезпечити розташування робочої точки на середині лінійної ділянки. Це досягається вибором початкового кута падіння оптичного пучка.

Електрична схема блоку формування імпульсів системи реєстрації оптоелектронного сенсора абсолютних кутових положень представлена на рисунку 14.3

Вихідні сигнали від фотодіодів надходять на одноконтактні контакти вилки XP1. Через провідники печатної плати сигнали надходять на входи мікросхеми DD1, є АЦП, що представляє інформацію в послідовному дванадцятироздрядному коді. Мікросхема DD2 є генератором змінної напруги.

Мікросхеми DD1 і DD2, працюючи в парі, дозволяють врахувати та компенсувати фазові зрушенні у вихідних синалах, що необхідно для отримання точних даних. Для цього сигнали надходять на відповідні входи генератора DD2. Сигнал компенсації фазового зсуву надходить із виходу SRF мікросхеми DD2 через ланцюг C12, R1 на вход REF мікросхеми DD1. Входи FS1... FS3 мікросхеми DD2 дискретно задають частоту генератора. При підключенні, вказаному на схемі, частота генератора дорівнює 2 кГц. За інших поєднань частоту можна підвищити до 20 кГц.

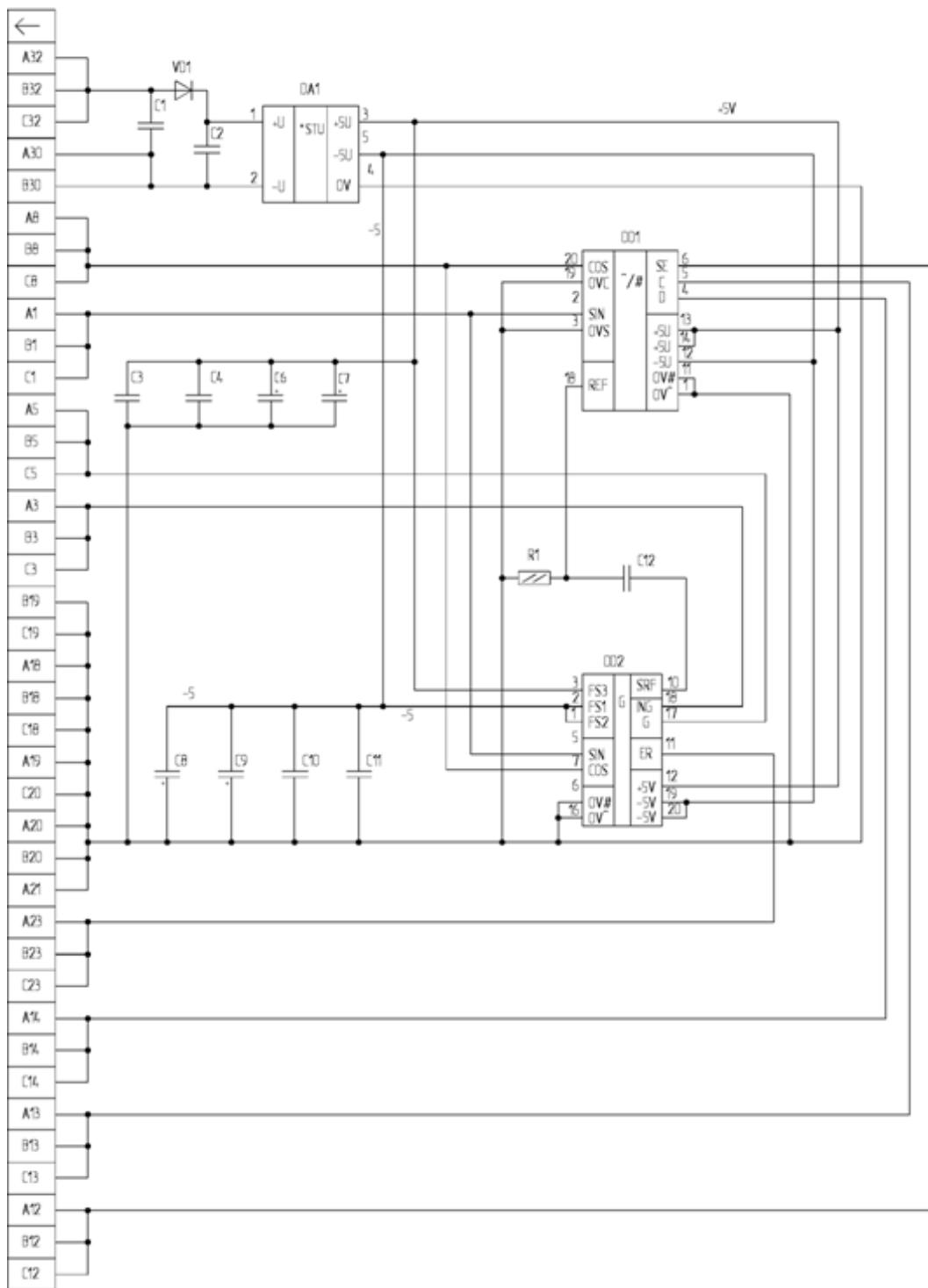


Рисунок 14.3 – Електрична схема блоку формування імпульсів системи реєстрації оптоелектронного сенсора абсолютних кутових положень

Живлення мікросхем DD1 і DD2 здійснюється двополярною напругою +5 і -5 В. Ці напруги створює імпульсний перетворювач напруги DA1. Діод VD1 захищає модуль від виходу з ладу при неправильному підключені по-люсів живлення. Конденсатори C1 та C2 зменшують перешкоди модуля в лінію живлення. Конденсатори C3 ... C11 знижують рівень перешкод, що над-

ходять по лініях живлення +5 -5 В і зменшують вплив мікросхем один на одного.

Інформація про кут повороту передається мікросхемою DD1 через контакти вилки XP1 по трипровідному кабелю.

Кут повороту перетворюється на послідовний двійковий код, який передається через послідовний інтерфейс: ДАНІ контакти A14, B14, C14 вилки XP1, ДОЗВІЛ ЧИТАННЯ контакти A12, B12, C12 вилки XP1 і ТАКТ контакти з номерами 13 вилки. Вихід ДАНІ утримується у високоімпедансному стані, коли вхід ДОЗВІЛ ЧИТАННЯ встановлено в логічну одиницю.

Коли зовнішній пристрій встановлює логічний 0 на вході ДОЗВІЛ ЧИТАННЯ, вихід ДАНІ активовано, і інформація про поточний кут передається через послідовний інтерфейс. Дані передаються, використовуючи часові параметри сигналу, що надходить вхід ТАКТ. Максимальна частота сигналу ТАКТ становить 2 МГц. Гарантується надійна передача даних через часовий інтервал 600 нс (0.6 мкс) після встановлення зовнішнім пристроєм логічного нуля на вході ДОЗВІЛ ЧИТАННЯ. Якщо потрібна точність вимірювання кута менше 12 біт, то сигнал ДОЗВІЛ ЧИТАННЯ переходить у високий рівень після читання необхідної кількості біт. Сигнал ДОЗВІЛ ЧИТАННЯ можна перевести у високий рівень, тим самим заборонивши читання, мінімум через 100 нс (0.1 мкс) після останнього негативного фронту імпульсу. Для повторення читання даних сигнал ДОЗВІЛ ЧИТАННЯ повинен бути відновлений мінімум через 250 нс. Час читання інформації про кут повороту можна розрахувати, враховуючи найбільшу довжину інформаційного кадру 12 біт і тактову частоту інформації - 2 МГц. Час читання складе $[600+(12 \times 500)+600+100] = 7.3$ мкс, що відповідає частоті трохи більше 135 кГц.

На рисунку 14.4 представлено часові діаграми функціонування пристрою.

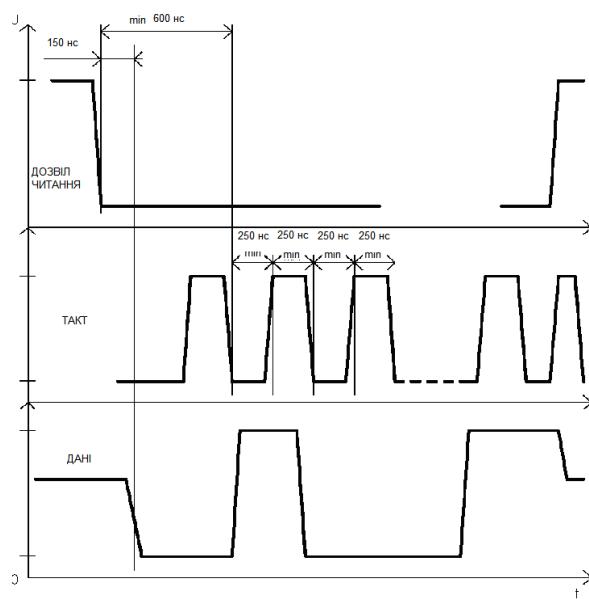


Рисунок 14.4 – Діаграми функціонування блоку формування імпульсів системи реєстрації оптоелектронного сенсора абсолютних кутових положень

Питання для закрілення вивченого матеріалу та самоконтролю.

1. Магнітні енкодери.
2. Оптичні енкодери.
3. Інкрементні оптичні енкодери.

Практичне завдання.

Виконати моделювання блоку формування імпульсів системи реєстрації оптоелектронного сенсора абсолютнох кутових положень в програмному середовищі Electronics Workbench 5.12

Для проведення аналізу функціювання схеми у якості об'єкта моделювання було обрано частину пристрою, яка відповідає за систему автоматизованого управління – блок формування імпульсів.

Моделювання проводилось у програмному середовищі Electronics Workbench 5.12.

Результати моделювання представлено на рисунках 14.14 та 14.15.

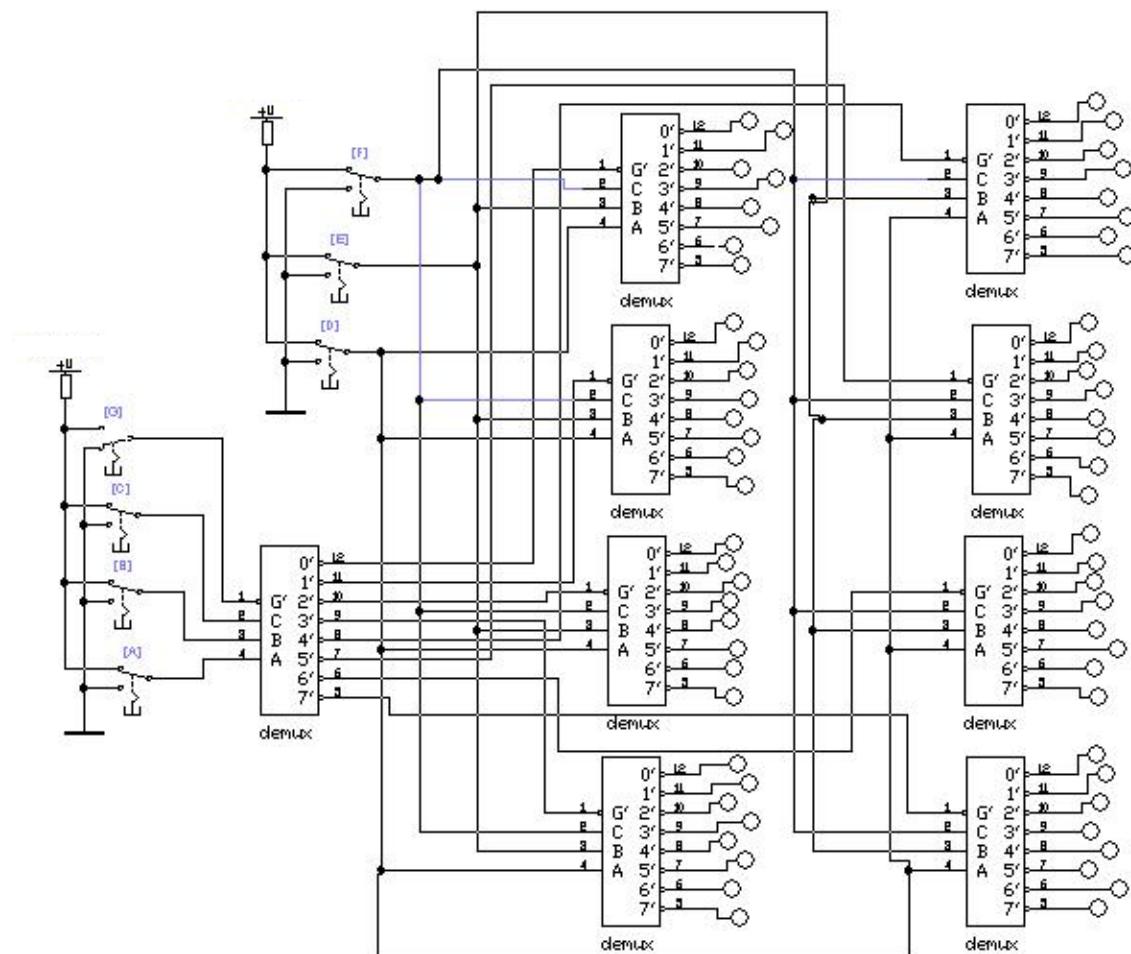


Рисунок 2.14 – Схема блоку формування імпульсів системи реєстрації оптоелектронного сенсора абсолютнох кутових положень в програмному середовищі Electronics Workbench 5.12

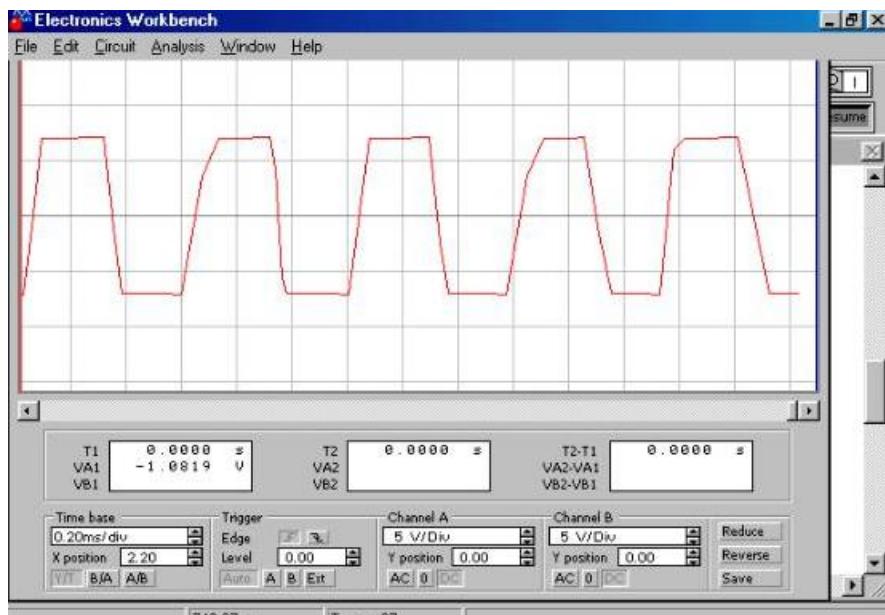


Рисунок 2.15 – Діаграма функціонування блоку формування імпульсів системи реєстрації оптоелектронного сенсора абсолютних кутових положень в програмному середовищі Electronics Workbench 5.12

Як видно із побудованих діаграм результати моделювання добре узгоджуються із раніше отриманими теоретичними розрахунками.

Отже, за результатами розділу можна зробити наступні висновки:

1) на підставі проведеного дослідження для розробки пристрою обрано лазерну схему вимірювання кутових положень. Новизною, вибраного прототипу є введення таких елементів, як операційного пристрію, один з входів якого підключений до першого додаткового вихіду модулятора струму напівпровідникового лазера з метою компенсації модуляційної перешкоди у вихідному сигналі фотодіода; формувача синхроімпульсів і формувача імпульсів фіксованої тривалості (стробімпульс), що забороняють роботу пристрою на час переходних процесів; компаратора, що формує імпульси з частотою інтерференційного сигналу; блок формування трьох імпульсних сигналів і вимірювачі (у цифровому вигляді) його вихідних сигналів; комп'ютер, управління роботою пристрою;

2) у якості безпосередньої сенсорної частини пропонується використати дифракційну решітку, яка розташовується безпосередньо на об'єкті дослідження;

3) операційну частину пристрою пропонується реалізувати на мікросхемі AD2S99BP, яка є високоефективним перетворювачем постійної напруги, що забезпечує роботу модуля в широкому діапазоні напруги живлення з рівнем шумів у вихідній напрузі 50 мВ;

4) проведено розробку друкованої плати блоку формування імпульсів системи реєстрації у редакторі Layout 4.0;

5) результати моделювання блоку формування імпульсів системи у програмному середовищі Electronics Workbench 5.12 показали відповідність із теоретичними розрахунками.

Контрольні питання

1. Принцип побудови оптоелектронних енкодерів.
2. Методи вимірювання кутового положення
3. Використання оптоелектронних енкодерів.

Література

1. Версьовкін Л.Л., Світанько М.В., Кісельов Є.М., Хрипко С.Л. Цифрова схемотехніка : підручник. Запоріжжя : ЗДІА, 2016. 214 с. ISBN 978-617-685-023-6
2. Медяний Л. П. Аналогова схемотехніка. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. 177 с.
2. Бойко В.І., Жуйков В.Я., Співак В.М. та ін. Основи технічної електроніки: Підручник. Київ : Вища школа., 2007. 510 с.